

年月日 12 02 14 ページ 23 NO.

今までに起っている現象を正確に計測・把握したいというのは、研究者であれば当たり前の発想だろう。しかし測定のために取り付けたセンサーが対象物に影響し、実際の条件から変わってしまうなら元も子もない。

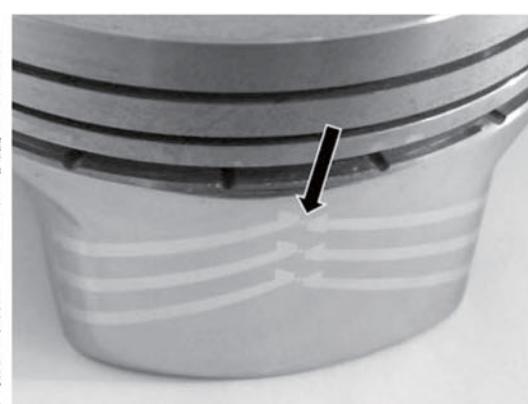
そこで進められているのが小型・薄膜センサーの開発だ。すでにその大きさは米粒よりも小さいものや、ただの印刷にしか見えないという領域まで進化している。開発の可

能性を広げる小型・薄膜センサーの現状とは。

(政年佐貴恵)

採訪 先端研究

薄膜センサー



東京都市大学

電気抵抗の変化測定

あらゆる機械の省エネ燃費向上が求められるようになり、内燃機関や歯車、軸受といった部品の形状や動作がこれまで度は測れなかつた。

矢印が開発した薄膜センサーは、導電性の部品の表面に厚さ100~200nmの絶縁膜と同0.1~0.2mm以上に厳しく評価されている。小型・軽量化には動作の把握が必須だが、エンジンを動かしながら実測するのは至難の業。測定には実験用の環境をつくりねばならない。内燃機関の状態はまだ分からぬことが多かった。

教授は「実際に動作した試作チップの大きさは2mm四方。支持体である絶縁膜上シリコン基板を含めると厚さは300nmだが、基板を薄くすれば100nmくらいまで薄くできるという。製造を自動化できれば、500nm四方以下の大きさになり、曲面に張り付けて面を曲げてもチップ

東大 摩擦変化で変形検知

デバイス層の厚さが20μmの触覚センサーを開発したのは、東京大学の下山勲教授だ。層内に對になった梁を作り、摩擦によつて生じた変形を抵抗の変化として検知する。出つ張り部分がないため高さに制限がなく、構造は単純で全工程を半導体プロセスで作れる。試作チップの大きさは2mm四方。支持体である絶縁膜上シリコン基板を含めると厚さは300nmだが、基板を薄くすれば100nmくらいまで薄くできるという。製造を自動化できれば、500nm四方以下の大きさになり、曲面に張り付けて面を曲げてもチップ

は壊れない。

センサーの小型化はこれまで取り付けられなかった場所に取り付けられるというだけでなく、測定できる周波数の範囲が広がり、わずかな力も検知できるなどのメリットがある。また複数並べれば微小領域の力の分布が分かる。小型・薄膜化がさらに進めば「細胞が大きくなるときの培養容器に働く力の測定や、タイヤと路面の局所的なすべりの予知・検知ができる」(下山教授)。これまで分からなかつた現象が明らかになり、さらに技術が飛躍する日も近そうだ。

(随時掲載)